

研究・開発に最適な 光応用製品



■ LCOS 型
空間光変調器



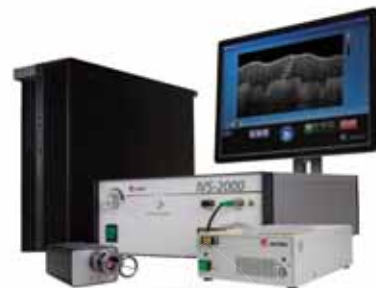
■ 波長可変レーザー



■ 光学特性検査システム



■ 偏波測定



■ 計測システム



■ 波長可変フィルタ



皆様のご研究にお役立ていただける
弊社製品のラインアップをウェブ
サイトにも掲載しています。

製品情報の詳細は、
裏面をご覧ください。

研究・開発に最適な光応用製品



■ 波長可変レーザー

最新ハイエンドモデル TSL-770



波長可変範囲 1480 to 1640 nm
最速 200 nm/s で全域モードホップフリー掃引可能
波長精度 0.5 pm、最大パワー + 13 dBm、
スペクトル線幅 60kHz、周波数ゆらぎ 従来比1/10以下

最新スタンダードモデル TSL-570



2021年4月リリースの最新鋭機
ご用途に合わせた波長帯や精度を選択可能
波長精度 3 pm ~、最大パワー + 13 dBm

超広帯域のフルバンドモデル Full-band TSL



波長可変範囲 1260 to 1680 nm (O to U-band)
100 nm/s 波長掃引可能
オペレーションソフトウェア付属

1 μ m 帯対応の特別モデル 1 μ m TSL * Preliminary



ご要望にお応えしついにラインアップ
1 μ m 帯で波長掃引が可能
詳細はお問い合わせください

ステップ可変エコノミーモデル WSL-110



最大 2 台のレーザーを搭載可能 (C or L-band)
任意波長に設定可能

高速波長掃引型 VCSEL タイプ HSL-1



MEMS 技術と VCSEL 技術を融合
中心波長 1060 nm、掃引速度可変 10 to 400kHz
LiDAR などのセンシング用光源に最適

高速波長掃引型 MEMS タイプ HSL-10/20



SS - OCT 用スタンダード光源
中心波長 1060 nm or 1310 nm
スキャンレンジ \geq 105 nm

■ LCOS 型空間光変調器

スタンダードモデル SLM-200



反射型 LCOS で光の位相を自由に変調
Full-HD 解像度、10-bit (1024 階調)
優れた位相安定度 ($\sim 0.001\pi$ rad.)

紫外線耐性モデル SLM-250



液晶及び光学薄膜構造を耐紫外線に最適化
波長範囲 365 to 550 nm

高出力耐性モデル SLM-300



液晶及び放熱構造を耐高出力レーザーに最適化
対応波長 532 nm、800 nm、1064 nm

■ 光学特性検査システム

スイープテストシステム

波長可変レーザー TSL シリーズ
マルチポートパワーメータ MPM シリーズ
偏波コントローラ PCU-110
マルチプランチユニット MBU



IL / WDL / PDL の効率的な測定を実現
分岐ユニットにより更なる検査・評価の効率化が可能
オペレーションソフトウェア付属

■ 波長可変フィルタ

フィルタ形状可変 Top flat タイプ OTF-980



透過波長と帯域幅を可変
非常に急峻なフィルタスロープ 1000 dB/nm
エコノミーモデル (OTF-350 手動可変) も用意

フィルタ形状 Gaussian タイプ OTF-930



豊富なフィルタ種類ラインアップ
低 PDL (< 0.1 dB) & 低 PMD (< 0.1 ps)
エコノミーモデル (OTF-320 手動可変) も用意

■ 偏波測定

偏光消光比モニタ PEM-340



偏光消光比、偏光角度、光強度を同時測定
最大 50 dB までの消光比をリアルタイムに測定可能
広い光入力範囲 (-40 to +20dBm / 1260 to 1630nm)

高消光比光源 PLS-100



0 から 180 度の間で偏光軸の角度を可変
45 dB (代表値) の高消光比
PMF デバイスの PER 測定に最適

■ 計測システム

ラック・マウント型 PD アレイ MPA-100



高集積、コストパフォーマンスに優れた光パワー計測器
当社製光部品 (タップ PD or Pigtail PD) を最大 80 ch 搭載
多 ch 常時光パワーモニタや検査等に最適

光学距離計測 OFDR * Preliminary



分解能 8 μ m で高速に光路長を計測
シリコンフォトニクス (SiP)、フォトニック集積回路 (PIC) の
ファイバ結合、デバイス内部の損失位置計測に最適
詳細はお問い合わせください

光学式断層測定 (OCT) IVS シリーズ



波長掃引型 OCT (Swept-Source OCT) システム
物の内部を非接触、非破壊、非侵襲で見ることが可能
最大 30 fps のリアルタイム・イメージング

光学式三次元計測 OPS-1000 * Preliminary



ダイナミックレンジ 70dB 超高感度 3D プロファイラー
高分解能 0.2 μ m ~、長い測定距離
形状、材料、色、表面、外乱光の状態を問わず、
非接触・高速計測が可能

www.santec.com